

技術講習会

蛍光 X 線膜厚計によるめっき膜厚測定

地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センターでは、所有している試験研究機器等を用いて、企業の皆様の新技術・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用可能範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用いただくため、下記の要領で講習会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

◆日 時：平成31年 1月16日（水）

① 10:20～11:20 ② 13:15～14:15

※各回（①、②）とも同じ内容の講習を行います。ご希望の時間帯をお選びください。

(バスでお越しの場合、①は10:03に、②は12:54に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。)

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。(営業時間 11:45～13:15)

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。(受付は講習会開始時間の10分前より始めます。)

◆定 員：各回につき人数は3名まで

※受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※お申込みは、メール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2520) でお願います。

◆対象機器：蛍光X線膜厚計 フィッシャー・インストルメンツ製 XDV-SDD

めっきの品質は外観では判断できない部分が多く、そのなかでもめっき膜厚は品質管理における基本要素です。膜厚の測定方法は複数ありますが、そのなかで蛍光X線膜厚計による測定は迅速・非破壊・微小部測定対応、という特徴から品質管理に適しています。

本講習会では、蛍光X線膜厚計についてあまり詳しくない方からご利用経験のある方までを対象に、膜厚測定の原理、測定手順、測定結果を読み取る際の注意点、適用例について解説し、実際に測定を体験していただきます。また、本機種によって新たに対応した測定方法の紹介も行います。



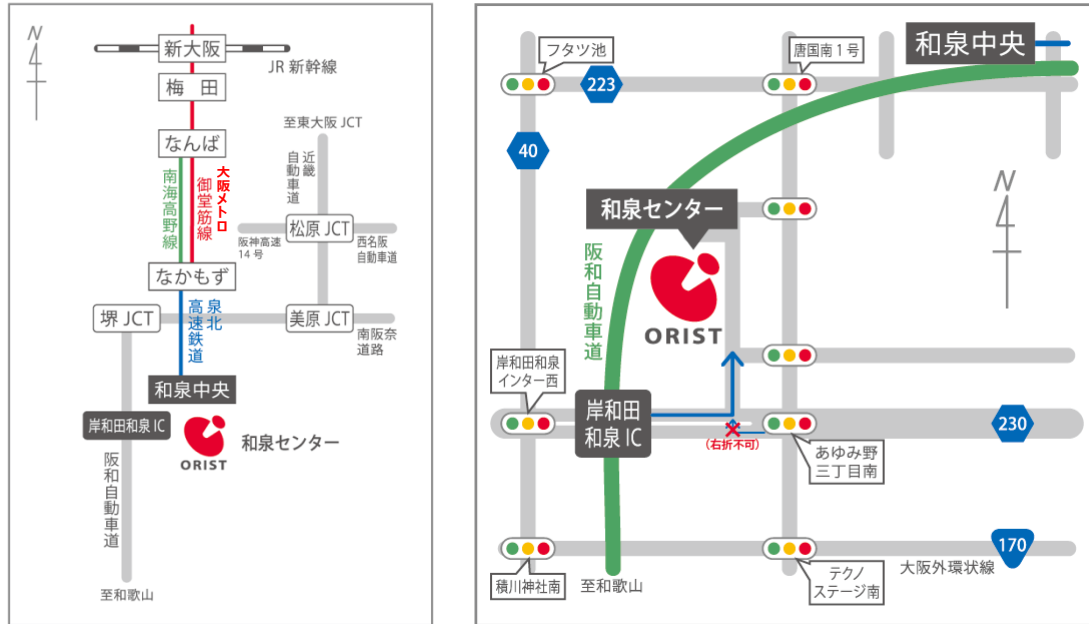
◆持ち込み試料について：受講者の方が用意した試料についての測定も可能です。ただし、試料の形状、素材やめっきの材質や膜厚によっては測定できない場合がございますので、試料持ち込みを希望される方は、事前に講習担当者までお問い合わせください。

◆講習担当：

(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 金属表面処理研究部 林彰平

・お問い合わせ先：顧客サービス部 TEL：0725-51-2518

大阪産業技術研究所 和泉センター 交通案内図（略図）



和泉中央駅バス乗り場5番から
研究所方面へのバスが出ております
和泉中央駅発バス時刻
9時：7, 27分
10時：3, 34, 57分
11時：21, 54分
12時～15時：毎24, 54分

駐車場は、入口から入って左手に
あります。ご利用下さい。

「大阪技術研前」で下車して下さい

FAX 0725-51-2520

技術講習会 申込書 テーマ「蛍光 X 線膜厚計によるめっき膜厚測定」 開催日：平成31年 1月16日（水）

会社名	(ー -)
所在地	(ー -)
参加者	所属： 役職： 氏名： (K) 利用者カードをお持ちの方は、「K 番号」のご記入もお願いします。
連絡先	TEL： FAX：
希望コース (希望のコース番号 をご記入ください)	第1希望： 第2希望： 平成31年 1月16日（水） ① 10:20～11:20 ② 13:15～14:15
講習会の情報源	①Web ページ ②メール配信 ③チラシ ④他機関の情報 ⑤その他 ()

※上記参加申込書に記載された内容につきましては、本講習会の参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。

- ①お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート。
- ②当研究所および関連団体の催事情報提供などの案内。

※ 講習会の申込状況の確認はこちら →<http://orist.jp/izumi/events/seminar/>

※ 講習会の案内など、当研究所の関連情報をお知らせする「ORIST EXPRESS 和泉センター版」の配信を新規にご希望の方はこちら →http://orist.jp/mail_magazine/magazine_izumi.html